

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of)
)
Dirk PREIKSZAS et al.)
)
Application No.: (unassigned))
)
Filed: July 16, 2003)
)
For: OBJECTIVE LENS FOR AN)
ELECTRON MICROSCOPY SYSTEM)
AND ELECTRON MICROSCOPY)
SYSTEM)

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

German Patent Application No. 102 33 022.6

Filed: July 19, 2002

In support of this claim, enclosed is a certified copy of said prior foreign application.

Acknowledgment of receipt of the certified copy is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: July 16, 2003

By: 

Charles F. Wieland III
Registration No. 33,096

P.O. Box 1404
Alexandria, Virginia 22313-1404
(703) 836-6620



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 33 002.6

Anmeldetag: 19. Juli 2002


Anmelder/Inhaber: LEO Elektronenmikroskopie GmbH, Oberkochen/DE

Bezeichnung: Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem
und Elektronenmikroskopiesystem

IPC: H 01 J 37/141

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 7. April 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag


Ebert

DIEHL · GLAESER HITTL & PARTNER

GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS

Patentanwälte · Augustenstrasse 46 · D - 80333 München

Dr. Hermann O. Th. Diehl · Diplom-Physiker
Joachim W. Glaeser · Diplom-Ingenieur*
Dr. Elmar Hittl · Diplom-Chemiker
Dr. Frank Schorr · Diplom-Physiker
Dr. Christian Huber · Diplom-Chemiker
Dr. Klaus Hinkelmann · Diplom-Chemiker

In Kooperation mit Diehl & Partner AG
CH - 7513 Silvaplana · Schweiz

Patentanwälte · European Patent Attorneys
München · Hamburg*

19. Juli 2002

Neue deutsche Patentanmeldung

Z8816-DE FS/FB/OC

Anmelder: LEO Elektronenmikroskopie GmbH

Carl-Zeiss-Straße 56
D-73447 Oberkochen
Deutschland

**Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem
und Elektronenmikroskopiesystem**

Kanzlei · Office: München

Telefon · Telephone
(089) 17 86 36-0

Telefax · Facsimile
(089) 1 78 40 33
(089) 1 78 40 34

E-mail/Internet
info@diehl.ccn.de
www.diehl-patent.de

Anschrift · Address
Augustenstrasse 46
D - 80333 München

Postanschrift · Mailing address
P.O. Box 34 01 15
D - 80098 München

5 **Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem
 und Elektronenmikroskopiesystem**

10 Die Erfindung betrifft ein Elektronenmikroskopiesystem mit
magnetischer und elektrischer Fokussierung und insbesondere
eine Objektivlinse für ein solches System. Ferner betrifft
die Erfindung ein Untersuchungssystem zum Abbilden und Ma-
nipulieren eines Objektes, welches ein solches Elektronen-
15 mikroskopiesystem umfaßt.

In einer Vielzahl von Fachbereichen und Anwendungsgebieten
zeichnet sich ein zunehmender Trend zur Miniaturisierung
ab. Insbesondere in der Halbleitertechnologie besteht Nach-
20 frage an immer kleineren, komplexeren und leistungsstärke-
ren Bauelementen. Es besteht somit beispielsweise im Rahmen
von Qualitätssicherung und Prozessanalyse ein Bedarf, die
Wafer und darauf entstehende bzw. fertige Bauelemente op-
tisch inspizieren zu können. Da die Größe der einzelnen
25 Strukturen der Bauelemente im Mikrometerbereich und darun-
ter liegt, werden üblicherweise Elektronenmikroskope ver-
wendet, um eine notwendige Vergrößerung und Auflösung zu
erzielen. Besonders vorteilhaft sind dabei solche Elektro-
nenmikroskopiesysteme, welche eine Abbildung der zu unter-
30 suchenden Struktur unter einer großen Zahl von Beobach-
tungswinkeln zulassen, was bei zunehmender Wafergröße spe-
zielle Anforderungen an die elektronenmikroskopische Anord-
nung stellt. Im Rahmen einer Charakterisierung einer
Struktur, insbesondere einer Halbleiterstruktur, besteht

eine Technik darin, einen Graben in die zu charakterisierende Struktur zu "fräsen", um einen Querschnitt durch die Struktur untersuchen zu können und so mit relativ geringem Arbeitsaufwand eine Fülle von Informationen, z.B. bezüglich Schichtenfolgen in der Struktur, erhalten zu können. Ein solcher Graben wird beispielsweise mit Hilfe eines fokussierten Ionenstrahls (focused ion beam, FIB) in die Halbleiterstruktur geätzt. Diese Ätzmethode ist besonders für die Herstellung von Probenquerschnitten für die Transmissionselektronenmikroskopie oder bei einer Struktur mit einer komplexen Schichtenfolge und unterschiedlicher Ätzselektivität der einzelnen Schichten von Bedeutung. Verfahren unter Verwendung eines FIB erlauben die Herstellung recht feiner und wohldefinierter Schnitte. Es ist bei dieser Methode vorteilhaft, den Ätzvorgang in situ mikroskopisch beobachten können.

Aus dem Stand der Technik sind bereits verschiedene Elektronenmikroskopiesysteme sowie eine Zahl von in solchen Systemen anwendbaren Objektivlinsen bekannt. Eine solche Objektivlinse, die sich als vorteilhaft erwiesen hat, sieht eine Kombination aus magnetischer und elektrischer Fokussierung bzw. Verzögerung vor.

Ein Beispiel einer herkömmlichen Objektivlinse ist in Fig. 1 schematisch dargestellt. Die Objektivlinse 1 umfaßt eine rotationssymmetrisch um eine optische Achse 2 der Objektivlinse angeordnete magnetische Linse mit einer Polschuhanordnung mit einem inneren Polschuh 11 und einem äußeren Polschuh 12 sowie mit einem in einem Raum zwischen innerem und äußerem Polschuh 11, 12 angeordneten Spulenkörper 15. Ferner umfaßt die Objektivlinse 1 eine elektrosta-

tische Immersionslinse mit einem eine erste Elektrode bildenden Strahlrohr 13 und einer Abschlußelektrode 14. Das Strahlrohr 13 ist im Wesentlichen in einem unteren Teil eines durch den inneren Polschuh 11 gebildeten Innenraums angeordnet, während die Abschlußelektrode 14 sich räumlich im Wesentlichen in z-Richtung an den äußeren Polschuh anschließt. Werden die zwischen den Polschuhen angeordneten Spulenwindungen der magnetischen Linse von Strom durchflossen, so wird im inneren Polschuh 11 und im äußeren Polschuh 12 ein magnetischer Fluß induziert. Dabei führt das Polschuhmaterial einen großen Teil des Flusses. In einem Bereich eines axialen Polschuhspalts 19 tritt ein durch die Polschuhe 11, 12 geklammertes magnetisches Feld bis auf die optische Achse 2 aus. Magnetfeldstärke und Ausdehnung des Magnetfeldes auf der optischen Achse 2 sind für die Fokusslänge von Bedeutung. Dabei ist die Brennweite proportional zur Beschleunigungsspannung der Elektronen geteilt durch das Ortsintegral über das Quadrat der magnetischen Flußdichte im Bereich der Polschuhe entlang des z-Achse.

20

Am Strahlrohr 13 der elektrostatischen Linse wird eine positive Spannung angelegt, während die Abschlußelektrode 14 vorzugsweise auf Erdpotential geschaltet ist. Die elektrostatische Linse erzeugt ein Verzögerungsfeld, in dem die Elektronen des Elektronenstrahls vor Verlassen der Elektronenoptik abgebremst werden. Dies erlaubt, daß die Elektronen des Elektronenstrahls den größten Teil des Strahlengangs zwischen Elektronenquelle und elektrostatischer Linse mit hoher Energie bzw. Geschwindigkeit durchlaufen können und so sich auf die Fokussierung negativ auswirkende elektrostatische Abstoßungserscheinungen der gleich geladenen Elektronen minimieren lassen. Das elek-

trische Feld zwischen Strahlrohrende und Abschlußelektrode 14 weist ferner eine Inhomogenität derart auf, daß dieses Feld ebenfalls fokussierend auf die dieses durchlaufende Primärelektronen wirkt.

5

Weiterhin hat sich als günstig erwiesen, dass ein durch die Magnetlinse der Objektivlinse erzeugtes Magnetfeld auf der Oberfläche eines Objekts - beispielsweise im Vergleich mit sog. "single-pole"-Linsen - relativ gering ist. Wie in Fig. 1 dargestellt, weist Objektivlinse 1 einen im Wesentlichen konischen äußeren Polschuh 12 mit einem Konuswinkel einer äußeren Seite des äußeren Polschuhs zur optischen Achse von 40° auf. Bedingt durch die Geometrie des äußeren Polschuhs 12 und den im Wesentlichen durch diese bestimmten Raumbedarf der elektronenmikroskopischen Linsenanordnung läßt sich ein zu untersuchendes Objekt bei einem kleinen Arbeitsabstand bis hin zu einem Winkel von $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ relativ zur optischen Achse des Elektronenmikroskopiesystems kippen.

20

Eine Elektronenmikroskopieanordnung, welche eine solche Objektivlinse umfasst, wurde ebenfalls vorteilhaft in einer Anordnung zum Abbilden und Manipulieren eines Objekts, die zusätzlich eine Vorrichtung zum Erzeugen und Steuern eines fokussierten Ionenstrahls (im folgenden auch als Ionenstrahlbearbeitungssystem oder FIB-Säule bezeichnet) aufweist, eingesetzt. Insbesondere ermöglicht es eine solche Anordnung, Abbilden und Bearbeiten der Struktur simultan auszuführen. Aufgrund des Raumbedarfs der obig beschriebenen Objektivlinse der elektronenoptischen Anordnung sowie der FIB-Säule kann ein zu untersuchendes flächig ausgedehntes Objekt bei simultanem Abbilden und Bearbeiten maximal

bis zu einem Winkel von 80° relativ zum Ionenstrahl angeordnet werden. Somit lassen sich in einem eine solche herkömmliche Objektivlinse umfassenden System mit Hilfe des FIB keine Gräben mit vertikalen Wänden in einem Objekt bei
5 simultaner Abbildung durch das Elektronenmikroskopie erzeugen. Vielmehr wird nach einem Arbeitsschritt zur Bearbeitung des Objekts durch den FIB das Objekt gekippt und verdreht, und anschließend die durch den FIB erzeugte Struktur abgebildet.

10

Bei gleichzeitigem Betreiben von Elektronenmikroskopieanordnung und fokussiertem Ionenstrahl ist allgemein ein Magnetfeld im Bereich des durch den Ionenstrahl manipulierten Objekts zu minimieren, da die Ionen durch das Magnetfeld
15 abgelenkt werden, was zu einer Beeinträchtigung der Bearbeitungspräzision des fokussierten Ionenstrahls führt. Ferner kann in einem solchen Magnetfeld eine Aufspaltung des Ionenstrahls nach Isotopen auftreten, was eventuell dessen Verwendbarkeit ganz ausschließt.

20

Entsprechend besteht ein Bedarf an einer Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem, welche einen verringerten Raumbedarf und ein minimiertes Magnetfeld außerhalb der Objektivlinse aufweist.

25

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem bereitzustellen. Es ist ferner eine Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Untersuchungssystem zum simultanen Abbilden und
30 Manipulieren eines zu untersuchenden Objekts vorzuschlagen.

Unter einem ersten Aspekt wird eine Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem mit magnetischer und elektrischer Fokussierung zum Abbilden eines in einer Objektebene anordenbaren Objekt bereitgestellt, welche umfasst:

- 5 • eine Polschuhanordnung zur Erzeugung eines fokussierenden Magnetfeldes, welche bezüglich einer sich in einer z-Richtung erstreckenden optischen Achse der Objektivlinse im wesentlichen rotationssymmetrisch ist und einen inneren Polschuh und einen äußeren Polschuh aufweist,
 - 10 wobei an einer in z-Richtung untersten Stelle des inneren Polschuhs, wo dieser von dem äußeren Polschuh einen in z-Richtung orientierten Spaltabstand aufweist, zwischen dem inneren und dem äußeren Polschuh ein Polschuhspalt ausgebildet ist,
- 15 • eine Elektrodenanordnung zur Erzeugung eines fokussierenden elektrischen Feldes, welche bezüglich der optischen Achse im wesentlichen rotationssymmetrisch ist, und umfasst: ein Strahlrohr, welches den inneren Polschuh entlang der optischen Achse durchsetzt und ein unteres Ende aufweist, und weiterhin eine mit Abstand von
 - 20 dem unteren Ende des Strahlrohrs angeordnete Abschlußelektrode,
 - wobei die Objektivlinse dadurch gekennzeichnet ist, dass in einem Bereich innerhalb von wenigstens 3 cm um den
 - 25 Polschuhspalt herum gilt:
 - der innere Polschuh verjüngt sich wenigstens bereichsweise (in z-Richtung) nach unten und weist dort einen inneren Konuswinkel (β) und einen äußeren Konuswinkel (χ) zur z-Richtung auf,
 - 30 - der äußere Polschuh erstreckt sich nach unten, insbesondere verjüngt er sich hierbei wenigstens bereichs-

weise, und weist unten einen inneren Konuswinkel (Δ) und einen äußeren Konuswinkel (α) zur z-Richtung auf, und dass weiterhin gilt:

- $30^\circ < \alpha < 35^\circ$ und $10^\circ < \Delta - \chi < 14^\circ$

5 und dass weiterhin

- ein Arbeitsabstand zwischen der Abschlußelektrode und der Objektebene für Elektronen, die das Strahlrohr mit etwa 30 keV durchlaufen, kleiner als oder gleich 2 mm ist.

10

Im Wesentlichen wurden Geometrie und Anordnung der Komponenten der herkömmlichen Objektivlinse verändert, um unter einem ersten Aspekt so den Winkel zwischen konischem äußeren Polschuh und z-Achse verringern zu können und damit den Raumbedarf der Objektivlinse und damit elektronenmikroskopischen Anordnung zu verringern. Dadurch kann ein im Wesentlichen flächig ausgedehntes Objekt bezüglich der optischen Achse der Elektronenmikroskopieanordnung stärker gekippt werden.

20

Die vorgeschlagene Änderung der Geometrie der herkömmlichen Objektivlinse, die zu einer die Aufgabe(n) lösenden Objektivlinse mit für das Elektronenmikroskopiesystem zufriedenstellenden optischen Parametern führt, ist dabei für den Fachmann nicht naheliegend, sondern aus einer Reihe von Gründen überraschend, wie nachfolgend dargestellt:

25

In der magnetischen Linse der Objektivlinse sollen der innere und der äußere Polschuh den gesamten magnetischen Fluß führen, so daß das magnetische Feld im Wesentlichen nur für die kurze Strecke des Polschuhspalts aus diesen austritt. Weiterhin ist eine magnetische Sättigung des die

30

Polschuhe ausbildenden Materials zu vermeiden, da eine solche Sättigung zu unreproduzierbaren und nicht rotations-symmetrischen Magnetfeldern und zu einer Verdrängung des Magnetflusses aus den Polschuhen heraus führen würde. Eine Fokussierung energiereicher Elektronenstrahlen würde im Falle einer Polschuhmaterialsättigung aufgrund des abgeschwächten Magnetfeldes beeinträchtigt. Daher würde eine Verringerung des Raumbedarfs der Magnetlinse durch eine Verringerung der Dicke der Polschuhe und damit Materialabtrag unter Beibehaltung der zur magnetischen Anregung durch die zwischen den Polschuhen angeordneten Spule verwendeten Parameter eine vorzeitige magnetische Sättigung des Materials und damit unzureichendes Fokussierungsvermögen der Objektivlinse erwarten lassen. Versuchte man, die Magnetlinse durch Verringerung des Abstandes, d.h. der Winkeldifferenz von innerem und des äußerem Polschuh zu verkleinern, würde diese Verringerung zu magnetischem Kurzschluß und damit zu nachteiligen Störungen des Magnetfeldes, insbesondere Verschiebungen, Verformungen und Abschwächungen des Feldes entlang der optischen Achse, führen. Außerdem würde dadurch der für die Spule zur Verfügung stehende Raum verkleinert, infolgedessen müßte zum Erhalt der zu einer genügenden Erregung notwendigen Anzahl der Windungen der Spule ein kleinerer Drahtdurchmesser für den für die Spule verwendeten Draht gewählt werden. Der mit einem kleineren Drahtdurchmesser verbundene höhere Ohm'sche Widerstand würde jedoch die von dem Draht der Spule erzeugte Wärmemenge erhöhen, was zur Vermeidung räumlicher Drifterscheinungen eine aufwendigere Kühlung als die verwendete Wasserkühlung erforderlich machen würde. Daher scheinen Materialabtrag an den Polschuhen und/oder eine Verringerung des Abstandes des inneren und äußeren

Polschuhs keine geeignete Maßnahmen zur Lösung der Aufgabe zu sein.

5 Zusammen mit einer Verringerung des Winkels α zwischen der Außenseite des äußeren Polschuhs und einer Verringerung der Dicken der Polschuhe wurde auch eine Anordnung der Polschuhe zueinander, insbesondere die Differenz des Winkels zwischen dem äußeren Winkel χ des inneren Polschuhs zur z-Achse und dem inneren Winkel Δ des äußeren Polschuhs zur z-Achse, und die Abmessung des Polschuhspalts bzw. -abstands, in nicht durch den Stand der Technik nahegelegter Weise abgewandelt, um zu einer überraschend leistungsfähigen Objektivlinse zu gelangen:

15 Zumindest in einem Bereich innerhalb von etwa 3cm um den Polschuhspalt liegt α erfindungsgemäß in einem Bereich von 30° bis 35° , die Differenz $\Delta - \chi$ in einem Bereich von 10° bis 14° , wobei mit dieser Anordnung bei Verwendung von Elektronen, die das Strahlrohr mit etwa 30 keV durchlaufen, ein Arbeitsabstand zwischen der Abschlußelektrode und der Objekzebene kleiner als oder gleich 2 mm erreicht wird. Besonders bevorzugt ist eine Anordnung, in der $\alpha = 34^\circ$ und $\Delta - \chi = 13^\circ$.

25 An einer in z-Richtung untersten Stelle des inneren Polschuhs weist dieser von dem äußeren Polschuh einen in z-Richtung orientierten Spaltabstand auf, wo zwischen dem inneren und dem äußeren Polschuh ein Polschuhspalt ausgebildet ist. Im Bereich des Polschuhspalts tritt das Magnetfeld in Richtung der optischen Achse aus. Die Abmessungen des
30 Polschuhspalts haben Einfluß auf die Stärke wie auch die

räumliche Ausdehnung des magnetischen Feldes auf der optische Achse und damit auf die Fokusslänge der Objektivlinse. Bei der Optimierung der Polschuhgeometrie sind die Eigenschaften der sphärischen und chromatischen Aberration gegenüber der Fokussierleistung, die durch die Feldabflachung aufgrund von Materialsättigung oder zu großer Spaltbreite verringert wird, abzuwägen. Es wird ein Polschuhspaltabstand von mindestens 3 mm gewählt. Bei der Angabe dieses Abstandes ist zu beachten, dass es sich hier gewissermaßen um einen effektiven Polschuhspaltabstand handelt. Das bedeutet, daß es möglich ist, durch Hinzufügen weiteren Materials in Form beispielsweise eines dünnen Fortsatzes oder dünner Filme oder Folien den Polschuhspalt bzw. Polschuhabstand zwar unter einem geometrischen, nicht jedoch unter einem funktionellen Aspekt zu verkleinern. Durch dieses hinzugefügte Material werden nämlich infolge magnetischer Sättigung im hinzugefügten Material das von der Magnetlinse erzeugte Magnetfeld und damit die von dem inneren und äußeren Polschuh ausgehenden magnetischen Feldlinien nicht wesentlich beeinflusst, oder das Material wird an einer Stelle hinzugefügt, an der sich ohnehin kaum noch Fluß im Polschuh befindet.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung erweitern sich eine innere und eine äußere Seite des inneren Polschuhs von einem in z-Richtung untersten Punkt des inneren Polschuhs in einer konischen Form nach oben. In einer alternativen, bevorzugten Ausführungsform ist der innere Polschuh derart ausgebildet, daß er sich von seinem unteren Ende in Form eines Zylindermantels etwa 1 mm bis 3 mm in z-Richtung nach oben erstreckt, bevor er sich dann zumindest auf einer äußeren Seite konisch erweitert.

Vorzugsweise weist der innere Polschuh zumindest an seinem unteren Ende einen Innendurchmesser von 6 mm bis 8 mm auf, wobei ein Innendurchmesser von 7,5 mm besonders bevorzugt ist.

Allgemein liegen die Konuswinkel unter Beachtung der zuvor aufgeführten Winkeldifferenzen bevorzugt in folgenden Bereichen:

- innerer Konuswinkel β des inneren Polschuhs zur z-Achse:
 $0^\circ < \beta < 15^\circ$
- äußerer Konuswinkel χ des inneren Polschuhs zur z-Achse:
 $12^\circ < \chi < \Delta - 15^\circ$
- innerer Konuswinkel Δ des äußeren Polschuhs zur z-Achse:
 $\alpha - 5^\circ < \Delta < \alpha + 1^\circ$

Die Abmessung des radial innersten, axial um die Achse angeordneten untersten Bereichs des äußeren Polschuhs liegt bevorzugt in einem Bereich von 0,5 mm bis 3 mm, die Abmessung des radial innersten, axial um die Achse angeordneten untersten Bereichs des inneren Polschuhs beträgt bevorzugt 10 mm und mehr.

Damit wurde, entgegen den Erwartungen des Fachmanns, sowohl Material von den Polschuhen entfernt sowie eine Winkeldifferenz zwischen den Polschuhen verringert, wobei trotz größerem Spaltabstand ein Arbeitsabstand von 2 mm und kleiner erreicht wird.

Unter einem weiteren Aspekt der Erfindung zeichnet sich eine Objektivlinse, alternativ oder ergänzend zu der obig

- beschriebenen besonderen geometrischen Ausgestaltung der durch die Polschuhordnung ausgebildeten Magnetlinse, durch eine magnetische Kopplung des äußeren Polschuhs und der Abschlußelektrode aus. Diese magnetische Kopplung wird
- 5 dadurch erreicht, daß der äußere Polschuh, welcher nach außen im wesentlichen durch eine Konusfläche mit einem Konuswinkel (α) zur z-Richtung begrenzt ist, und die Abschlußelektrode, welche nach außen im Wesentlichen durch eine Konusfläche mit einem Konuswinkel (α') zur z-Richtung
- 10 begrenzt ist, im wesentlichen spaltfrei magnetisch miteinander gekoppelt sind. Diese magnetische Kopplung bewirkt eine bessere Abschirmung des Magnetfeldes zu Bereichen außerhalb der Objektivlinse hin, was besonders vorteilhaft ist in Fällen, wo das Magnetfeld mit einer Probe störend
- 15 interferiert oder auch bei der gleichzeitigen Bearbeitung des untersuchten Objekts mit Hilfe eines fokussierten Ionenstrahls, da das Magnetfeld die Ionen ablenken und damit den Bearbeitungsvorgang stören würde.
- 20 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird die magnetische Kopplung zwischen Abschlußelektrode und äußerem Polschuh dadurch erreicht, daß ein Spalt zwischen der Abschlußelektrode und dem äußeren Polschuh kleiner als 0,6 mm und noch mehr bevorzugt kleiner als 0,2 mm ist. Ein solcher
- 25 Spalt zwischen Abschlußelektrode und äußerem Polschuh wird vorteilhaft dadurch ausgebildet, daß sich ein Bereich der Abschlußelektrode und ein Bereich des äußeren Polschuhs flächig gegenüberliegen.
- 30 Besonders bevorzugt wird die Abschlußelektrode durch eine sich von einem unteren Bereich des äußeren Polschuhs aus entlang der Innenseite des inneren Polschuhs erstreckenden

Kunststoffisolierung sowie elektrisch isolierte Klammern gehalten. Dies ermöglicht es insbesondere, die Abschlußelektrode, welche durch einen Spalt elektrisch isoliert von dem äußeren Polschuh ist, auf ein anderes Potential als
 5 Erdpotential schalten zu können, was für verschiedene Anwendungen vorteilhaft ist. Weiterhin erlaubt dies, die Abschlußelektrode unabhängig vom äußeren Polschuh austauschen zu können.

10 Weiter bevorzugt ist eine Anordnung von äußerem Polschuh und Abschlußelektrode, in der die sich zumindest teilweise im Wesentlichen konisch erstreckenden Außenseiten des äußeren Polschuhs und der Abschlußelektrode miteinander fluchten.

15

Die Abschlußelektrode ist vorteilhaft derart gestaltet, daß sie sich bis zu einer zentralen Öffnung an einem unteren Ende der Abschlußelektrode hin im Wesentlichen konisch verjüngt und so das elektrische Feld vergleichsweise nahe an
 20 einem Objekt bzw. einer Probe bereitgestellt wird. Da die Abschlußelektrode vorzugsweise auf Erdpotential geschaltet ist, ist in einem Bereich der Probe das elektrische Feld jedoch vernachlässigbar klein. Die Nähe des Feldes zur Probe ist insbesondere bei größeren Arbeitsabständen W_D ,
 25 d.h. Abständen zwischen Abschlußelektrode und Probenoberfläche, von Vorteil. Der Innendurchmesser der zentralen Öffnung der Abschlußelektrode entspricht im wesentlichen einem Innendurchmesser des Strahlrohrs, es sind aber auch Ausführungsformen vorgesehen, in denen die zentrale Öffnung
 30 am unteren Ende der Abschlußelektrode einen anderen Innendurchmesser aufweist als der Innendurchmesser des Strahlrohrs.

Unter einem dritten Aspekt der Erfindung ist die elektrische Linse der Objektivlinse, alternativ oder ergänzend zu den obig beschriebenen besonderen geometrischen Parametern der Magnetlinse und/oder magnetischen Kopplung von äußerem Polschuh und Abschlußelektrode, derart ausgestaltet, daß ein Abstand zwischen dem unteren Ende des inneren Polschuhs und dem unteren Ende des Strahlrohrs größer als 9 mm und weiter bevorzugt größer als 10 mm ist. In einer besonders bevorzugten Ausbildungsform ist ein Abstand zwischen dem unteren Ende des Strahlrohrs und einem unteren Ende der Abschlußelektrode größer als 3 mm, besonders bevorzugt ist ein Abstand von etwa 6 mm.

Dieser Anordnung liegt die Idee zugrunde, eine Überlappung des durch die Magnetlinse erzeugten Magnetfeldes und des durch die Abschlußelektrode und Strahlrohr umfassende elektrostatische Linse erzeugte elektrische Feld gegenüber der aus dem Stand der Technik bekannten Anordnung zu verkleinern. Insbesondere überlappen das elektrische und das magnetische Feld bei einer solchen Linsengeometrie um weniger als 5% (bezogen auf die Feldintegrale). Damit weist das durch die magnetische Linse erzeugte Magnetfeld einen größeren Abstand zu einem abzubildenden Objekt auf, wodurch ein Magnetfeld auf dem Objekt minimiert wird. Gründe, warum diese Feldminimierung auf dem Objekt vorteilhaft ist, wurden bereits zuvor angesprochen. Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass das elektrische Feld nahe zur Probe angeordnet ist, was besonders bei größeren Arbeitsabständen vorteilhaft ist.

Unter einem weiteren Aspekt weist das untere Ende des Strahlrohrs einen Endflansch auf, welcher sich radial über einen Außendurchmesser des Strahlrohrs hinaus erstreckt. Dabei weist der das Strahlrohr umschließende Endflansch einen Abstand zu der Abschlußelektrode auf, welcher groß genug ist, um ein Auftreten elektrischer Überschläge oder Kurzschlüsse zu verhindern. Dieser Endflansch ist vorzugsweise derart ausgebildet, daß er im Axialquerschnitt von einem in Richtung der Objektebene weisenden Frontabschnitt zu einem Mantelabschnitt in verrundeter Form übergeht, wobei diese Verrundung einen Krümmungsradius von mindestens einem Millimeter aufweist. Dieser besonderen Ausgestaltung des Strahlrohrs liegt die Idee zugrunde, im Bereich im Wesentlichen zwischen innerem Polschuh und Strahlrohr angeordnete, aus Kunststoff gefertigte Komponenten der Objektivlinse vor einer Aufladung durch eine beim Betreiben der Elektronenmikroskopieanordnung unausweichlich auftretenden Elektronenwolke zu schützen, indem gewissermaßen der direkte Zugang zu diesem Bereich durch die Abschirmung durch den Endflansch erschwert wird und der Primärelektronenstahl ähnlich wie durch einen Faraday'schen Käfig abgeschirmt wird. Der Endflansch kann auch derart ausgestaltet sein, daß ein Übergang von der den Innendurchmesser begrenzenden Innenwand des Strahlrohrs zur Frontfläche verrundet ausgebildet ist.

Bei allen obig angeführten Ausgestaltungen wird für die Polschuhe vorzugsweise ein Material gewählt, das eine hohe Sättigungsmagnetisierung aufweist. Besonders bevorzugt wird für die Polschuhe eine Eisen-Nickel-Legierung mit einem Nickel-Gehalt von 45% bis 50% verwendet. Besonders bevorzugt ist eine NiFe-Legierung mit dem Handelsnamen

"Permenorm 5000 H3", kommerziell erhältlich von der Vacuum-schmelze Hanau, Deutschland. Vorteilhaft können auch eine Cobalt-Eisen-Vanadium-(49%Co-49%Fe-2%V)-Legierung, Cobalt-Eisen-Legierungen (z.B. 30% Co, 70% Fe) oder Weicheisen
5 verwendet werden.

Das Spulenmaterial umfasst vorzugsweise Kupferdraht. Die Spule ist thermisch von den Polschuhen isoliert, wobei bei Stromdurchfluß in der Spule generierte Wärme von einem
10 thermisch mit der Spule gekoppelten, im Innenraum zwischen dem inneren und dem äußeren Polschuh angeordneten Wasserkühlungsrohr aufgenommen und durch den Kühlkreislauf abtransportiert wird.

15 Für die Abschlußelektrode wird bevorzugt ein sogenanntens µMetall (Mumetall®), d.h. eine Nickel-Eisen-Legierung mit einem Nickel-Anteil von 72 - 89%, gewählt, besonders bevorzugt Hyperm 766.

20 Bevorzugt sind in der Objektivlinse weiterhin mehrere Ablenkspulen zum Ablenken des Elektronenstrahls vorgesehen, so dass der Elektronenstrahl über einen definierten Bereich einer Objektoberfläche rastern kann. Neben der voranstehend beschriebenen Objektivlinse umfasst ein Elektronenmikro-
25 skopiesystem weitere Komponenten: eine Probenkammer, in der ein zu untersuchendes Objekt angeordnet ist, eine Elektronenstrahlquelle zum Erzeugen und Beschleunigen eines Elektronenstrahls, Elektronenoptik mit einer oder mehreren elektrostatischen und/oder magnetischen Linse(n), zumindest
30 ein Vakuumsystem zum Evakuieren zumindest der vom Elektronenstrahl durchsetzten Räume des Elektronenmikroskops und der Probenkammer, eine Objekthalterung in der Proben-

kammer zum Anordnen und Ausrichten eines Objekts vor dem Elektronenmikroskop und zumindest einen Detektor zum Detektieren von Elektronen, insbesondere Sekundärelektronen. In einer bevorzugten Elektronenmikroskopieanordnung ist zu-
 5 mindest ein Detektor in einem Innenraum des Elektronenmikroskops, welcher in z-Richtung oberhalb der Objektivlinse angeordnet ist, vorgesehen.

10 Unter einem zusätzlichen Aspekt stellt die Erfindung ein Untersuchungssystem zur Beobachtung und zur Manipulation eines zu untersuchenden Objekts bereit, welches folgende Komponenten umfaßt:

- 15 • ein Elektronenmikroskopiesystem mit einer Objektivlinse mit einem oder mehreren Merkmalen gemäß obiger Beschreibung,
- ein Ionenstrahlbearbeitungssystem zum Manipulieren des Objekts mittels eines emittierten Ionenstrahls,
- 20 • eine Objekthalterung zur Halterung und Ausrichtung des Objekts vor dem Ionenstrahlbearbeitungssystem und dem Elektronenmikroskopiesystem, mit der ein flächig ausge-
 dehntes Objekt derart vor dem Elektronenmikroskopie-
 system ausrichtbar ist, daß der Ionenstrahl die
 25 Objektoberfläche orthogonal schneidet.

Große Vorteile ergeben sich aus einer Kombination des vor-
 anstehend beschriebenen Elektronenmikroskopiesystems mit
 einem Ionenstrahlbearbeitungssystem. Das Ionenstrahlbear-
 30 beitungssystem ist zur Erzeugung und Lenkung eines fokus-
 sierten Ionenstrahls vorgesehen, mit Hilfe dessen ein zu
 untersuchendes Objekt beispielsweise durch Abtragen von Ma-

terial aus einem definierten Bereich der Oberfläche des Objekts manipuliert wird. Neben der Möglichkeit zur Untersuchung von Objekten z.B. in Hinblick auf deren Topographie besteht auch die Möglichkeit, Reparaturarbeiten an lithographischen Masken oder direktschreibende Lithographieverfahren unter Verwendung dieser Anordnung auszuführen. Es sind darüber hinaus weitere Anwendungsmöglichkeiten denkbar. Das Ionenstrahlbearbeitungssystem umfaßt zum Erzeugen eines Ionenstrahls eine Ionenquelle, für die häufig eine Flüssigmetall-Ionenquelle (häufig Gallium oder Indium) verwendet wird sowie eine Extraktionselektrode zum Extrahieren von Ionen aus der Ionenquelle durch Anlegen eines elektrischen Feldes. Weiterhin umfaßt eine Ionenoptik des Ionenstrahlbearbeitungssystems zum Beschleunigen, Fokussieren und Führen bzw. Ablenken des Ionenstrahls zumindest eine Beschleunigungselektrode, elektrostatische Linsen, eine variable Apertur und Ablenkeinheiten.

Das Elektronenmikroskopiesystem und das Ionenstrahlbearbeitungssystem sind derart zueinander angeordnet, daß sich ihre optischen Achsen im Wesentlichen in einer durch eine Oberfläche des zu untersuchenden Objekts definierten Ebene schneiden. Das Objekt wird von einer Objekthalterung gehalten, die eine definierte Ausrichtung des Objekts vor Elektronenmikroskopiesystem und Ionenstrahlbearbeitungssystem erlaubt. So läßt sich der Winkel, unter dem der fokussierte Ionenstrahl und der fokussierte Elektronenstrahl auf der Objektoberfläche auftreffen, in einem definierten Winkelbereich einstellen. Dies erlaubt beispielsweise das Erzeugen von Löchern und Gräben mit unterschiedlich steilen Seitenwänden. Insbesondere läßt sich der Ionenstrahl senkrecht zum Objekt anordnen und ermöglicht daher das Erzeugen

von Gräben mit senkrechten Seitenwänden, welchen für bestimmte Anwendungsbereiche eine große Bedeutung zukommen.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand von Figuren näher erläutert. Hierbei zeigt:

- Figur 1 eine Querschnittsansicht durch einen unteren Teil einer herkömmlichen Objektivlinse für ein Elektronenmikroskopiesystem,
- Figur 2 eine Illustration der in der Beschreibung definierten Winkel und Abmessungen im Bereich eines Polschuhspalts der Objektivlinse,
- Figur 3 eine Querschnittsansicht durch ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Objektivlinse,
- Figur 4 einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 3,
- Figur 5 einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 3 bzw. 4,
- Figur 6 ein Diagramm der für ein Polschuhmaterial eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Objektivlinse charakteristischen Parameter Feldstärke und Flußdichte,
- Figur 7 ein Diagramm der Überlagerung eines elektrischen magnetischen Felds in einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Objektivlinse,

Figur 8 eine schematische Darstellung eines erfindungsge-
mäßigen Untersuchungssystems zum Abbilden und
Manipulieren eines Objekts.

5

Eine in Figuren 3, 4 und 5 dargestellte Objektivlinse 100
dient zur Fokussierung eines Elektronenstrahls in einer
Elektronenmikroskopieanordnung. Die Objektivlinse 100 um-
faßt eine Magnetlinse sowie eine elektrostatische Linse,
10 folglich erfolgt die Fokussierung sowohl elektrostatisch
wie auch magnetisch. Die elektrostatische Linse dient auch
zum Abbremsen der Elektronen des Primärelektronenstrahls.
Die Magnetlinse umfaßt eine Polschuhanordnung mit einem in-
neren Polschuh 111 und einem äußeren Polschuh 112. Beide
15 Polschuhe 111, 112 sind eine zentrale optische Achse 101,
d.h. den Strahlengang eines Primärelektronenstrahls um-
schließend rotationssymmetrisch ausgebildet.

Der innere Polschuh 111 weist in z-Richtung im Wesentlichen
20 eine konische Form auf und verjüngt sich in diesem konus-
förmigen Bereich kontinuierlich in Richtung zur Objektebene
hin. In einem in z-Richtung untersten Bereich des inneren
Polschuhs 111 weist dieser einen sich in z-Richtung über
etwa 2,2 mm erstreckenden hohlzylinderförmigen Bereich 111'
25 auf. Die innere Seite 190 des inneren Polschuhs 111 ver-
läuft von einer in z-Richtung untersten Stelle 192 zunächst
über etwa 32 mm hinweg parallel zur Achse 101 und erstreckt
sich dann entlang einem Konus mit einem Winkel β von $10,5^\circ$
zur z-Achse bis dieser in einen Radialflansch 111'' über-
30 geht, der in seinem äußeren Bereich einem Radialflansch-
bereich 112' des äußeren Polschuhs 112 gegenüberliegt. Die
äußere, von der Achse 101 weiter entfernte Fläche 191 des

inneren Polschuhs 111 verläuft lediglich in dem hohlzylinderförmigen Bereich 111' etwa über 2,2 mm parallel zur optischen Achse und geht dann in einen Konus mit einem Winkel χ von 16° zur z-Achse über, bis dieser in einen Radialflanschenteil 111'' des inneren Polschuhs 111 übergeht.

Der äußere Polschuh 112 erstreckt sich bis zu einem oberen Flanschbereich 112' im Wesentlichen konisch in z-Richtung. Dabei bildet eine innere Seite 180 des äußeren Polschuhs 112 in diesem konischen Bereich einen Winkel Δ von 29° zur Achse 101 aus, während eine äußere Seite 181 sich unter einem Winkel α von 34° zur Achse 101 nach radial außen erstreckt. An einer untersten Stelle 182 des äußeren Polschuhs 112 weist dieser eine zentrale Öffnung auf, deren Innendurchmesser im Wesentlichen gleich dem Innendurchmesser D_1 (vgl. Fig. 2) der Öffnung an einer in z-Richtung untersten Stelle 192 im inneren Polschuh 111 entspricht.

Aufgrund der unterschiedlichen Konusöffnungswinkel des inneren und des äußeren Polschuhs (111, 112) nimmt ein Abstand der beiden Polschuhe in Richtung zur Objektebene hin ab und erreicht in einem unteren Bereich 111' des inneren Polschuhs 111 eine kleinste Dimension. Zwischen einer untersten Stelle 192 des inneren Polschuhs 111 und einer untersten Stelle 182 des äußeren Polschuhs 112 wird ein parallel zur z-Richtung verlaufender, axialer Polschuhspalt 119 mit einem Polschuhabstand ausgebildet. Der Polschuhspalt 119 hat in dieser Ausführungsform eine axiale Länge von etwa 6 mm.

30

Die Anordnung und Ausgestaltung des Polschuhspalts 119 ist für die Funktion der Magnetlinse von großer Bedeutung. Die

Polschuhe 111, 112 "klammern" in gewisser Weise das magnetische Feld. Die Feldlinien verlaufen zwischen dem oberen und dem Polschuh in bauchig in Richtung optischer Achse 101 ausgewölbter Form. Eine maximale Feldstärke auf der optischen Achse 101 wird im Bereich des Polschuhspalts 119 erreicht, wobei die Feldstärke des erzeugten magnetischen Feldes im Wesentlichen in z-Richtung eine Glockenform aufweist.

10 In der in Figur 3 dargestellten Ausführungsform ist an dem untersten Ende 192 des inneren Polschuhs 111 im Polschuhspalt 119 ein flacher Stützring 116 aus nicht-magnetischem Material angeordnet, der den gleichen Innendurchmesser wie der hohlzylinderförmige Bereich 111' des inneren Polschuhs 15 111, jedoch einen größeren Außendurchmesser aufweist.

Im Polschuhspalt ist weiterhin ein aus elastischem Material gefertigter Dichtungsring 130 vorgesehen, der an Bereichen des Stützrings 116, des äußeren Polschuh 112 und einem unteren Bereich einer Isolierung 118' anliegt und eine Dichtung des durch die Polschuhe 111, 112 eingeschlossenen Raumes von dem Vakuumraum im Bereich eines zu untersuchen- 20 den Objekts und innerhalb des Elektronenmikroskopiesystems bereitstellt.

25

Die Polschuhanordnung ist aus Permenorm® 5000 H3, einer Eisen-Nickel-Legierung, durch Drehen und anschließendes Ausglühen gefertigt. Ein Diagramm der vom Feld abhängigen Flußdichte bzw. Magnetisierung dieses Materials ist in 30 Figur 5 wiedergegeben.

In dem zwischen dem inneren Polschuh 111 und dem äußeren Polschuh 112 gebildeten Innenraum ist ein Spulenkörper 115 angeordnet. Der Spulenkörper 115 umfaßt coaxial zur optischen Achse angeordnete Drahtspulen mit einer Drahtdicke von 0,8 mm und ist aus Kupfer gefertigt. Die Zahl der Windungen beträgt 650. Die Spulen können bei einer Stromstärke von maximal 2A betrieben werden. Eine bei Stromdurchfluß durch die Spulen entstehende Wärmeleistung liegt im Bereich von etwa 20 Watt. Zwischen die Spulenwindungen ist ein Epoxy-Harz eingefüllt, der nach Aushärten thermische und mechanische Stabilität hervorruft.

Der Spulenkörper 115 ist in seiner Form im Wesentlichen der Form des durch die Polschuhe 111, 112 gebildeten Innenraums angepaßt, ohne diesen völlig auszufüllen. So erstrecken sich eine obere Seite und eine innere und eine äußere Seite des Spulenkörpers 115 im Wesentlichen parallel zu den jeweiligen, gegenüberliegenden Flächen der Polschuhanordnung. Zur äußeren Seite 191 des inneren Polschuhs 111, im Wesentlichen zur oberen Seite hin und zu einer unteren Seite hin wird der Spulenkörper 115 durch eine erste Ummantelung 120 spaltfrei eingeschlossen und in einem sich parallel zur z-Achse erstreckenden Bereich der äußeren Seite des Spulenkörpers 115 durch eine zweite Ummantelung 122 spaltfrei umschlossen. Die Ummantelungen 120, 122 sind aus Kupfer gefertigt und dienen der Aufnahme und Ableitung von Wärme, die bei Stromdurchlauf in den Drahtspulen des Spulenkörpers 115 erzeugt wird.

Zwischen der Ummantelung 120 und der äußeren Seite 191 des inneren Polschuhs 111 ist ein sich über die Gesamtheit des der Ummantelung 120 gegenüberliegenden Bereich des inneren

Polschuhs 111 ein Spalt 123 belassen, um eine thermische Isolierung bereitzustellen und eine Erwärmung des Polschuhmaterials im Wesentlichen zu verhindern. In einem in z-Richtung obersten Bereich des inneren Polschuhs 111 ist ein ringförmiger Abstandhalter 131 zwischen einem kurzen, vertikalen Fortsatz 120' der Ummantelung 120 und der äußeren Seite 191 des inneren Polschuhs 111 eingesetzt, um eine Berührung von Polschuh 111 und Ummantelung 120 zu verhindern und den Spalt 123 bereitzustellen. An den vertikalen Fortsatz der Ummantelung 120 schließt sich in horizontaler Richtung nach radial außen ein von Kühlwasser durchflossenes Rohr 121 an.

Die zweite Ummantelung 122 weist im Wesentlichen eine invertierte L-Form auf und verläuft parallel zu einem zur Achse 101 parallelen Abschnitt der äußeren Seite des Spulenkörpers 115, während sie sich in horizontaler Richtung räumlich an die erste Ummantelung 120 anschließt und eine Bohrung zur Aufnahme einer Schraube 153 aufweist, die zum Verbinden von innerem Polschuh 111 und Spulenkörper 115 mit Ummantelungen 131, 120 unter Verwendung eines Vermittlungskörpers 135 vorgesehen ist. Zwischen einem Kopf der Schraube 153 und der Ummantelung 122 ist eine Unterslagscheibe 132 angeordnet. Der Flanschbereich 111'' inneren Polschuhs 111 sowie ein diesem gegenüberliegender Flanschbereich 112' des äußeren Polschuhs 112 weisen miteinander fluchtende Bohrungen 154 und 155 zum Verschrauben der beiden Polschuhe 111, 112 miteinander auf. Der äußere Polschuh 112 weist darüberhinaus an seiner äußeren Seite 181 im Bereich des Übergangs von Konusform zum Flanschbereich 112' eine Stufenform auf, die der Einpassung der Pol-

schuhanordnung in ein entsprechendes, zur Aufnahme gefertigtes Teil der Elektronenmikroskopieanordnung dient.

Eine Isolierung 118 aus Kunststoff erstreckt sich parallel zu und entlang der inneren Seite 190 des inneren Polschuhs 111 in einem unteren Bereich über ein unterstes Ende 192 des inneren Polschuhs 111 hinaus bis etwa zu einer untersten Stelle 182 des äußeren Polschuhs 112. In einem oberen Bereich geht die Isolierung 118 parallel zum Inneren Polschuh 111 in einen Flanschbereich 118'' über, der etwa bis zur Mitte des Flanschbereichs 111'' des inneren Polschuhs 111 reicht. In einem Randbereich des Flanschteils 118'' der Isolierung 118 ist eine Bohrung zur Aufnahme einer die Isolierung 118 mit dem inneren Polschuh 111 verbindenden Schraube 152 vorgesehen. Ebenfalls in einem Flanschbereich 118'' der Isolierung 118 ist in einer dem inneren Polschuh 111 zugewandten Seite der Isolierung 118 eine ringförmige Aussparung zur Aufnahme eines Dichtungsringes 133 vorgesehen. In einem konusförmigen Bereich der inneren Seite des inneren Polschuhs 111 ist die Isolierung 118 vom inneren Polschuh 111 unter Belassung eines Spalts beabstandet. Ebenso wie der innere Polschuh 111 nimmt die Isolierung 118 in einem unteren Bereich eine Hohlzylinderform 118' an. In diesem hohlzylinderförmigen Bereich 118' der Isolierung 118 weist diese eine ringförmige, sich fast über die gesamte Höhe des hohlzylinderförmigen Bereichs erstreckende Aussparung 117 auf, die nicht dargestellte sattelförmige Ablenkspulen nochmal zum Ablenken des Elektronenstrahls aufnimmt.

30

In den Innenradius des hohlzylinderförmigen Bereichs 118' der Isolierung 118 ist das eine erste Elektrode der elek-

trostatischen Linse ausbildende Strahlrohr 113 eingepasst. Das Strahlrohr 113 erstreckt sich in z-Richtung sowohl über ein oberes wie auch ein unteres Ende des Hohlzylinderbereichs 118' der Isolierung 118 hinaus. Der Innendurch-

5 messer des Strahlrohrs 113 beträgt etwa 4,5 mm. Ein unteres Ende des Strahlrohrs 113 weist einen Abstand zur untersten Stelle 182 des äußeren Polschuhs 112 von etwa 5 mm auf. Wie insbesondere aus Figur 5 ersichtlich, weist das Strahlrohr 113 in dieser Ausführungsform einen Endflansch 113' auf,

10 der im axialen Querschnitt eine verrundete Form aufweist und an seiner größten sich radial nach außen erstreckenden Ausdehnung einen Durchmesser von etwa 8,5 mm aufweist. Der Endflansch 113' geht von einem in Richtung der Objektebene weisenden Frontabschnitt 113'' in verrundeter Form in einen

15 im Wesentlichen parallel zur Achse 101 angeordneten Mantelabschnitt 113''' über, wobei der Krümmungsradius R_F dieser Verrundung etwa 2 mm beträgt. Der diesem Endflansch 113' zuweisende unterste Teil der Isolierung 118 und die Form des Endflansches 113' des Strahlrohrs 113 sind derart

20 aneinander angepasst, dass ihre Flächen im Wesentlichen parallel angeordnet sind und so ein Spalt 136 von halbrunder Form mit gleichmäßigem Abstand um den Endflansch 113' herum entsteht. Der Endflansch 113' dient dazu, den Kunststoff der Isolierung 118 vor Elektronen und durch diese

25 verursachte Aufladung zu schützen.

Des weiteren weist die elektrostatische Linse der Objektivlinse 100 eine Abschlußelektrode 114 als eine zweite Elektrode auf. Diese Abschlußelektrode 114 ist im Wesent-

30 lichen von konischer Form, wobei ein Winkel zwischen einer äußeren Seite der Abschlußelektrode 114 und der Achse 101 gleich dem Winkel α zwischen der äußeren Seite 181 des

äußeren Polschuhs 112 und der Achse 101 ist, wobei äußerer
 Polschuh 112 und Abschlußelektrode 114 miteinander fluch-
 ten. Die Abschlußelektrode 114 verjüngt sich in z-Richtung
 bis hin zu einer zentralen Öffnung von etwa 5 mm Innen-
 5 durchmesser. An einem oberen Ende der Abschlußelektrode 114
 geht diese in einen ring- bzw. hohlzylinderförmigen Bereich
 114' über, wobei eine Außenfläche dieses Ringbereichs 114'
 einer axialen Innenfläche des äußeren Polschuhs 112 flächig
 gegenüberliegt und der zwischen diesen ausgebildete, etwa
 10 150 µm breite Spalt schmal genug ist, um eine magnetische
 Kopplung von Abschlußelektrode 114 und äußerem Polschuh 112
 zu ermöglichen, wodurch eine noch bessere Abschirmung des
 Magnetfeldes in der Objektivlinse 100 von einem Bereich
 außerhalb der Objektivlinse 100 erreicht wird.

15 Ein unterstes Ende des Strahlrohrs 113 weist in z-Richtung
 einen Abstand von etwa 5 mm zu einer untersten Stelle der
 Abschlußelektrode 114 auf. Während am Strahlrohr 113 eine
 positive Spannung von 8kV anliegt, ist die Abschluß-
 20 elektrode 114 auf vorzugsweise auf Erdpotential geschaltet.
 Durch die Wahl dieser gegenüber dem Stand der Technik
 größeren Abstände der Elektroden 113, 114 der elektrostati-
 schen Linse voneinander und von der Polschuhordnung wird
 das elektrostatische Verzögerungs- und Fokussierungsfeld
 25 von dem durch die Polschuhordnung erzeugten Magnetfeld
 weitgehend separiert, die Felder der beiden Linsen überlap-
 pen in einem Bereich von weniger als 5% ihrer Feld-
 integrale, wie aus dem Diagramm in Figur 7 ersichtlich.

30 Die Abschlußelektrode 114 ist aus Mumetall®, nämlich einem
 von der Vakuumschmelze Hanau, Deutschland, unter dem Namen
 Hyperm 766 erhältlichen Material gefertigt.

Die Abschlußelektrode 114 wird durch zwei gegenüber-
 liegende, in einem oberen Bereich mit Schrauben 151 am
 äußeren Polschuh 112 befestigte Klammern 150 gehalten. Die
 5 Klammern 150 sind in ihrem unteren Bereich an einem ober-
 sten konusförmigen Abschnitt der Abschlußelektrode 114 an-
 geordnet. Die Abschlußelektrode wird durch die Isolierung
 118' gehalten und zentriert. Zur elektrischen Isolation der
 Klammern 150 vom äußeren Polschuh 112 wird keramisches Iso-
 10 lierungsmaterial unter der äußeren Polschuh 112 und Klammer
 150 verbindenden Schraube 151 verwendet. Diese Anordnung
 bzw. Halterung ermöglicht ein leichtes Auswechseln der Ab-
 schlußelektrode 114. Zudem kann die Abschlußelektrode 114
 elektrisch isoliert von dem äußeren Polschuh 112 auf ein
 15 anderes Potential als Erdpotential geschaltet werden.

In Figur 4 ist zusätzlich ein zu untersuchendes Objekt 400
 sowie ein Arbeitsabstand W_0 zwischen einem untersten Ende
 der Abschlußelektrode 114 und einer Oberfläche des Objekts
 20 400 dargestellt.

In Figur 8 ist in schematischer, vereinfachter Form ein
 Ausführungsbeispiel des Untersuchungssystem zum Abbilden
 und Manipulieren eines Objekts 400 dargestellt. Das Unter-
 25 suchungssystem umfasst Elektronenmikroskopiesystem 300 zum
 Abbilden eines Bereichs des Objekts 400 sowie Ionenstrahl-
 bearbeitungssystem 200 zum Manipulieren des Objekts 400.

Wie aus Figur 8 ersichtlich, schneiden sich die optischen
 30 Achsen von Elektronenmikroskopiesystem 300 und Ionenstrahl-
 bearbeitungssystem 200 im Wesentlichen in einer durch die
 plane Oberfläche des Objekts 400 definierten Ebene, wobei

die optische Achse des Ionenstrahlbearbeitungssystems 200 in etwa orthogonal zu dieser Ebene angeordnet ist und der Ionenstrahl entsprechend senkrecht auf eine Oberfläche des Objekts 400 auftrifft. Der Einfallswinkel des Elektronen-
 5 strahls auf das Objekt 400 beträgt in der Figur dargestellten Anordnung in etwa 35° , während der Arbeitsabstand, d.h. der Abstand zwischen der Oberfläche des Objekts 400 und der untersten, radial innersten Stelle in der zentralen Öffnung der Abschlußelektrode etwa 4 mm beträgt.

10

Im Elektronenmikroskopiesystem 300 wird ein Primärelektronenstrahl durch eine Elektronenstrahlquelle erzeugt, welche eine Kathode 301, vorzugsweise einen Schottky-Feldemitter, und eine der Kathode 301, gegenüber-
 15 liegende Anode 303 umfaßt. Die emittierten Elektronen durchlaufen zudem einen zwischen Kathode 301 und Anode 303 angeordneten Extraktor 302. Der beschleunigte Primärelektronenstrahl tritt durch eine Bohrung am Boden der Anode 303 hindurch und wird anschließend von einer Kollimatoranordnung 304 kollimiert. Der Elektronenstrahl durch-
 20 läuft nach einer Aperturblende 305 einen Innenraum 306 des Elektronenmikroskopiesystems 300, in dem ein nicht dargestellter Detektor zum Nachweis von Sekundärelektronen oder Rückstreuelektronen angeordnet ist. Mittels der aus der
 25 Polschuhanordnung mit innerem Polschuh 309 und äußerem Polschuh 308 sowie dem zwischen diesen angeordneten Spulenkörper 307 ausgebildeten Magnetlinse und der elektrostatischen Linse 310, 311, welche zusammen die Objektivlinse ausbilden, wird der Elektronenstrahl fokussiert. In der Ob-
 30 jektivlinse sind zudem symmetrisch um den Strahlengang herum Sattelspulen zum Ablenken des Elektronenstrahls angeordnet. Aus der Objektivlinse tritt der Elektronenstrahl

aus und trifft unter einem Winkel von etwa 35° bei einem Arbeitsabstand von etwa 4 mm auf die Objektoberfläche. Die Objektivlinse wurde im vorangehenden Ausführungsbeispiel bereits detailliert beschrieben.

5

Ionenstrahlbearbeitungssystem 200 weist eine Ionenquelle 201 auf, die eine Anordnung mit einem an einer Spitze angeordneten Tropfen flüssigen Galliums umfasst, aus welchem mit Hilfe einer Extraktionselektrode 202 ein Ionenstrahl extrahiert wird. Dieser durchläuft, vereinfacht dargestellt, beim Durchgang durch die Ionenoptik der FIB-Säule 200 nacheinander einen Kollimator 203, eine variable Blende 204, einen Satz von Elektroden 205 und 206 zur Ablenkung und Ausrichtung des Ionenstrahls und schließlich eine Anordnung von strahlformenden Einzellinsen 207, bevor der Ionenstrahl aus der FIB-Säule austritt.

Der fokussierte Ionenstrahl trifft in Figur 8 etwa rechtwinklig zur Objektoberfläche auf das Objekt, so dass Gräben oder Löcher mit senkrechten Wänden in der Objektoberfläche bei simultaner Beobachtung durch die Elektronenmikroskopieanordnung erzeugt werden können.

Weiterhin ist in Figur 8 eine Objekthalterung 401 zum Haltern und Ausrichten des Objekts 400 vor Elektronenmikroskopiesystem 300 und Ionenstrahlbearbeitungssystem 200 angedeutet.

Ein großer Vorteil des erfindungsgemäßen Systems ist es, ein Objekt gleichzeitig beobachten und bearbeiten zu können. Abbilden der Objektbearbeitung in situ ist insbesondere zur Endpunktbestimmung bei der Erzeugung besonders

komplexer und/oder kleiner Strukturen von Bedeutung. Simultanes Bearbeiten und Abbilden wird unter anderem dadurch ermöglicht, daß das magnetische Feld der Magnetlinse der Objektivlinse des Elektronenstrahlmikroskopiesystems derart durch die Objektivlinse abgeschirmt wird, daß im Bereich der Objektoberfläche bzw. des vom Ionenstrahl durchsetzten Raums ein Magnetfeld so gering ist, daß kein oder ein vernachlässigbar kleiner störender Einfluß auf den Ionenstrahl ausgeübt wird. Dies ist insbesondere gegenüber sogenannten "single pole"-Objektivlinsen von großem Vorteil, deren Raumbedarf zwar recht klein gestaltet werden kann, die jedoch naturgemäß ein großes Magnetfeld im Bereich des Objekts erzeugen und so nicht gleichzeitig mit einem fokussierten Ionenstrahl eingesetzt werden können.

15

Ausgehend von einem Winkel von 34° oder weniger zwischen der Außenseite des äußeren Polschuhs der Objektivlinse der Elektronenmikroskopieanordnung und einem Winkel von 20° zwischen einer zumindest in einem dem Objekt zuweisenden unteren Bereich konusförmig gestalteten Außenseite der FIB-Säule und deren optischer Achse (halber Öffnungswinkel) lassen sich FIB-Säule und Elektronenmikroskopieanordnung in einer Ebene senkrecht zur Objektebene derart anordnen, daß in dieser 180° überspannenden Ebene der fokussierte Ionenstrahl unter einem Winkel von etwa 21° bis $(180^\circ - 2 \times 34^\circ - 20^\circ =) 92^\circ$ auf das Objekt treffen kann, wobei der Elektronenstrahl gleichzeitig unter einem Winkel von etwa $(0^\circ + 2 \times 20^\circ + 34^\circ =) 74^\circ$ bis $(180^\circ - 34^\circ =) 146^\circ$ auf das Objekt treffen kann, wobei der Winkel zwischen Elektronenstrahl und Ionenstrahl immer mindestens $(20^\circ + 34^\circ =) 54^\circ$ beträgt. Damit läßt sich der fokussierte Ionenstrahl auch

beispielsweise um 2° in jede Richtung abweichend von der Orthogonalen auf die Objektebene richten, was zum Beispiel für das Erzeugen von Proben für die Transmissions-elektronenmikroskopie von Bedeutung ist.

5

LEO Elektronenmikroskopie GmbH
Z8816-DE FS/BH/NS

5

Patentansprüche

1. Objektivlinse (100) für ein Elektronenmikroskopie-
system mit magnetischer und elektrischer Fokussierung
10 zur Erzeugung einer Abbildung eines in einer
Objektebene anordenbaren Objekts, umfassend:
eine bezüglich einer sich in einer z-Richtung er-
streckenden optischen Achse (101) der Objektivlinse
(100) im wesentlichen rotationssymmetrische Pol-
15 schuhanordnung zur Erzeugung eines fokussierenden
Magnetfeldes mit einem inneren Polschuh (111) und
einem äußeren Polschuh (112), wobei ein Polschuhspalt
(119) zwischen dem inneren und dem äußeren Polschuh
(111, 112) gebildet ist an einer in z-Richtung unter-
20 sten Stelle des inneren Polschuhs (192), wo dieser von
dem äußeren Polschuh (112) einen in z-Richtung orien-
tierten Spaltabstand aufweist,
eine bezüglich der optischen Achse (101) im wesent-
lichen rotationssymmetrische Elektrodenanordnung zur
25 Erzeugung eines fokussierenden elektrischen Feldes mit
einem den inneren Polschuh (111) entlang der optischen
Achse (101) durchsetzenden Strahlrohr (113) mit einem
unteren Ende und
einer mit Abstand von dem unteren Ende des Strahlrohrs
30 (113) angeordneten Abschlußelektrode (114),
dadurch gekennzeichnet, daß in einem Bereich innerhalb
von wenigstens 3 cm um den Polschuhspalt (119) gilt:

wenigstens bereichsweise verjüngt sich der innere Polschuh (111) nach unten und weist dort einen inneren

Konuswinkel (β) und einen äußeren Konuswinkel (χ) zur z-Richtung auf,

5 der äußere Polschuh (112) erstreckt sich wenigstens bereichsweise konisch nach unten und weist dort einen inneren Konuswinkel (Δ) und einen äußeren Konuswinkel (α) zur z-Richtung auf,

und wobei gilt: ein Arbeitsabstand zwischen der Abschlußelektrode (114) und der Objektebene ist kleiner als 2 mm für Elektronen, die das Strahlrohr (113) mit etwa 30 keV durchlaufen, und wobei gilt:

$30^\circ < \alpha < 35^\circ$ und $10^\circ < \Delta - \chi < 14^\circ$.

15 2. Objektivlinse (100) nach Anspruch 1, wobei der äußere Polschuh sich nach unten verjüngt.

3. Objektivlinse (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Spaltabstand größer als 3 mm ist.

20

4. Objektivlinse (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der innere Polschuh (111) sich von seinem unteren Ende (192) aus als ein Zylindermantel (111') etwa 1 mm bis 2 mm nach oben erstreckt und dann sich
25 konisch erweitert.

25

5. Objektivlinse (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der innere Polschuh (111) an seinem unteren Ende (192) einen Innendurchmesser von 6 mm bis 8 mm aufweist.
30

30

6. Objektivlinse (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5
oder dem Oberbegriff von Anspruch 1, wobei der äußere
Polschuh (112) außen im wesentlichen durch eine Konus-
fläche mit einem Konuswinkel (α) zur z-Richtung be-
grenzt ist, wobei die Abschlußelektrode (114) außen im
wesentlichen durch eine Konusfläche mit einem Konus-
winkel (α') zur z-Richtung begrenzt ist, wobei die Ab-
schlußelektrode (114) im wesentlichen spaltfrei
magnetisch an den äußeren Polschuh (112) gekoppelt
ist.
7. Objektivlinse (100) nach Anspruch 6, wobei ein Spalt
zwischen der Abschlußelektrode (114) und dem äußeren
Polschuh (112) kleiner als 0,6 mm, vorzugsweise klei-
ner als 0,2 mm ist.
8. Objektivlinse (100) nach Anspruch 6 oder 7, wobei ein
Bereich der Abschlußelektrode (114) einem Bereich der
des äußeren Polschuhs (112) flächig gegenüberliegt.
9. Objektivlinse (100) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
wobei die Abschlußelektrode (114) im wesentlichen bis
zu einer zentralen Öffnung in der Abschlußelektrode
(114) hin sich konisch verjüngt.
10. Objektivlinse (100) nach Anspruch 9, wobei ein Innen-
durchmesser der Öffnung der Abschlußelektrode (114) im
wesentlichen einem Innendurchmesser des Strahlrohrs
(113) entspricht.
11. Objektivlinse (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 10
oder dem Oberbegriff von Anspruch 1, wobei ein Abstand

zwischen einem unteren Ende (192) des inneren Polschuhs (111) und dem unteren Ende des Strahlrohrs (113) größer ist als 9 mm, insbesondere größer als 10 mm ist.

5

12. Objektivlinse (100) nach Anspruch 11, wobei das untere Ende des Strahlrohrs (113) einen sich radial über einen Außendurchmesser des Strahlrohrs hinaus erstreckenden Endflansch (113') aufweist.

10

13. Objektivlinse (100) nach Anspruch 12, wobei der Endflansch (113') im Axialquerschnitt einen verrundeten Übergang von einem Frontabschnitt (113'') in einen Mantelabschnitt (113''') aufweist, wobei ein Krümmungsradius der Verrundung größer als 1 mm ist.

15

14. Objektivlinse (100) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei ein Abstand zwischen dem unteren Ende des Strahlrohrs (113) und einem unteren Ende der Abschlußelektrode (114) größer als 3 mm ist.

20

15. Untersuchungssystem zur Beobachtung und zur Manipulation eines zu untersuchenden Objekts (400), umfassend:

25

ein Elektronenmikroskopiesystem (300) mit einer Objektivlinse nach einem der Ansprüche 1 bis 14, und ein Ionenstrahlbearbeitungssystem (200) zum Manipulieren des Objekts (400) mittels eines emittierten Ionenstrahls,

30

eine Objekthalterung (401) zur Halterung und Ausrichtung des Objekts (400) vor dem Ionenstrahlbearbeitungssystem (200) und dem Elektronenmikroskopie-

system (300), mit der ein flächig ausgedehntes Objekt (400) derart vor dem Elektronenmikroskopiesystem (300) und dem Ionenstrahlbearbeitungssystem (200) ausrichtbar ist, daß der Ionenstrahl die Objektoberfläche orthogonal schneidet.

5

16. Untersuchungssystem nach Anspruch 15, wobei das Objekt (400) derart vor dem Elektronenmikroskopiesystem (300) und dem Ionenstrahlbearbeitungssystem (200) ausrichtbar ist, daß der Ionenstrahl die Objektoberfläche um einen Winkel von bis zu 2° von der Orthogonalen auf die Objektoberfläche abweichend schneidet.

10

LEO Elektronenmikroskopie GmbH
Z8816-DE FS/FB/NS

5

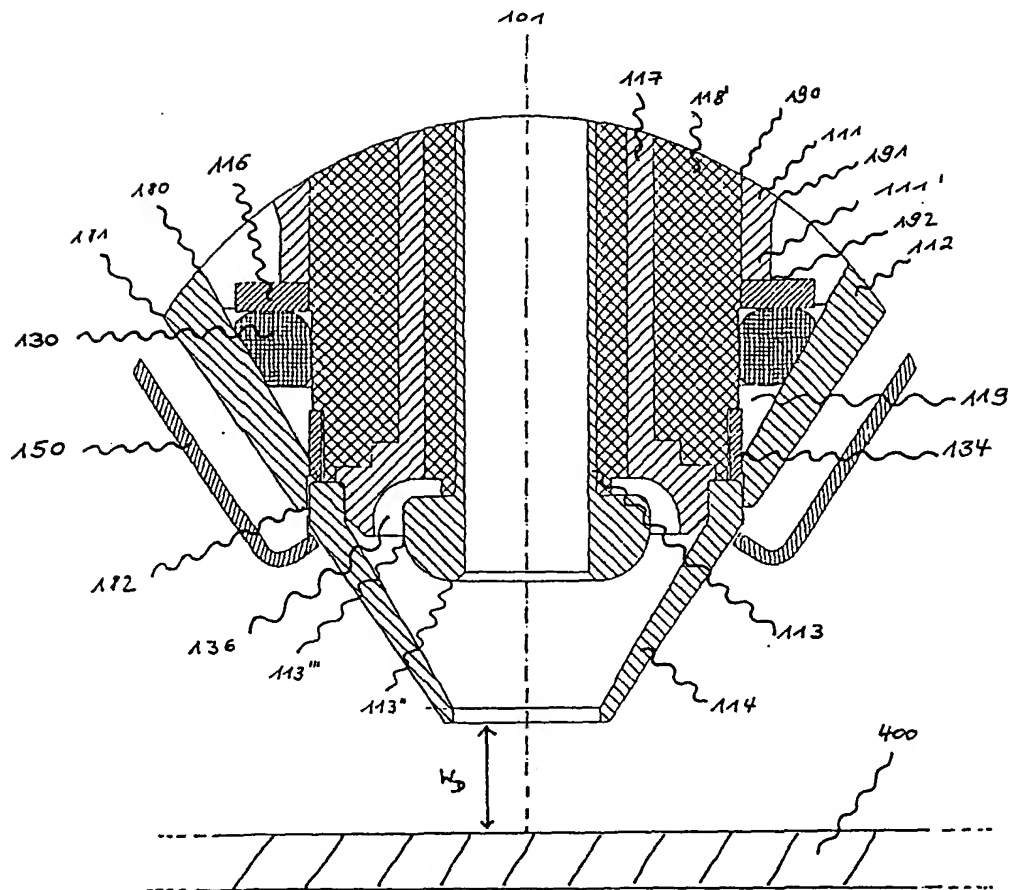
Zusammenfassung

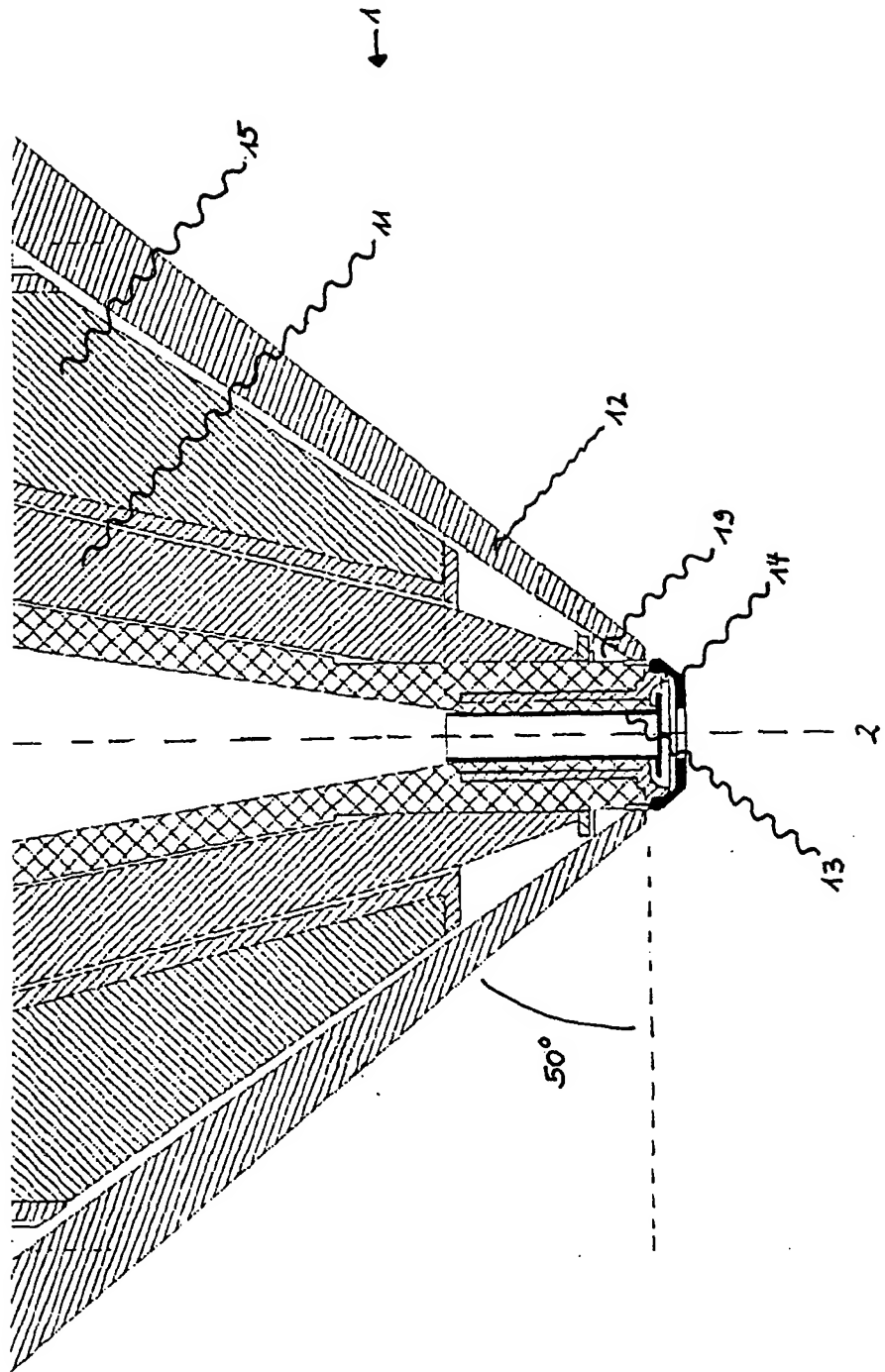
Es wird eine Objektivlinse mit magnetischer und elektro-
statischer Fokussierung für ein Elektronenmikroskopiesystem
vorgeschlagen, deren zumindest teilweise konische Außenform
10 eine Ausrichtung eines abzubildenden Objekts unter einem
großen Winkelbereich zum Elektronenstrahl ermöglicht und
die dabei gute optische Parameter aufweist. Dies wird er-
möglicht durch eine besondere Geometrie der Linsenelemente.
Weiterhin wird ein Untersuchungssystem zum simultanen Ab-
15 bilden und Bearbeiten eines Objekts vorgeschlagen, das
neben einem Elektronenmikroskopiesystem mit der obigen
Objektivlinse auch ein Ionenstrahlbearbeitungssystem und
eine Objekthalterung umfasst.

20

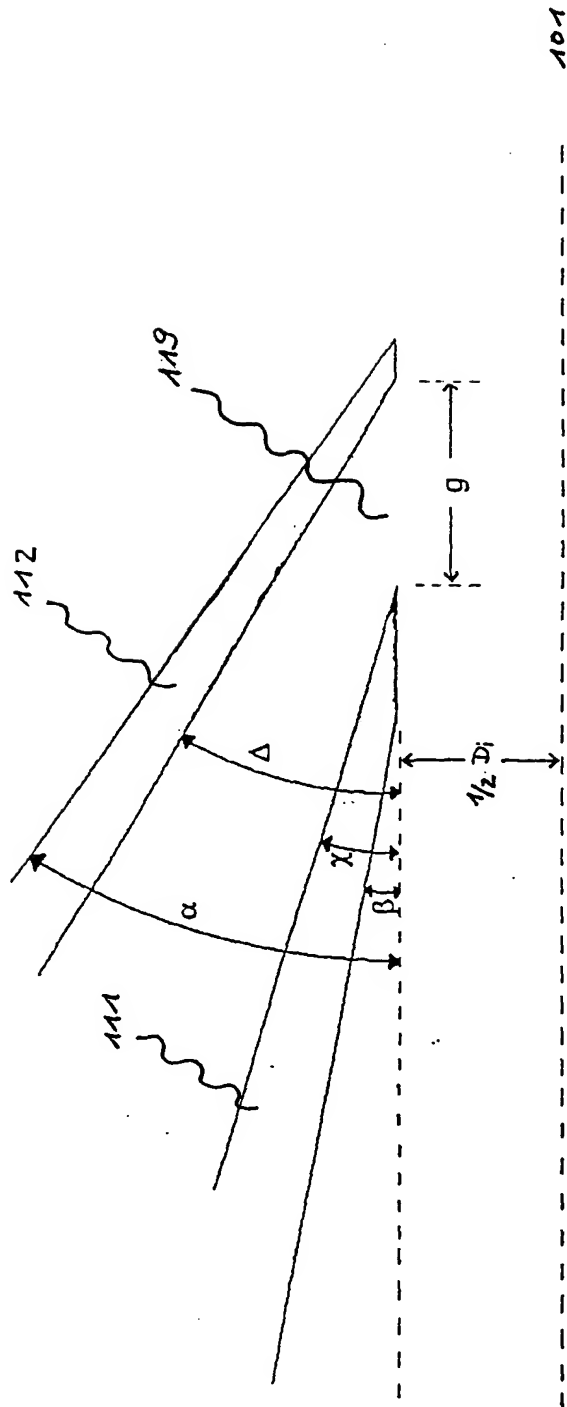
(Figur 4)

Zeichnung zur Zusammenfassung
(Figur 4)





Standard Technik
Figure 1



Figur 2

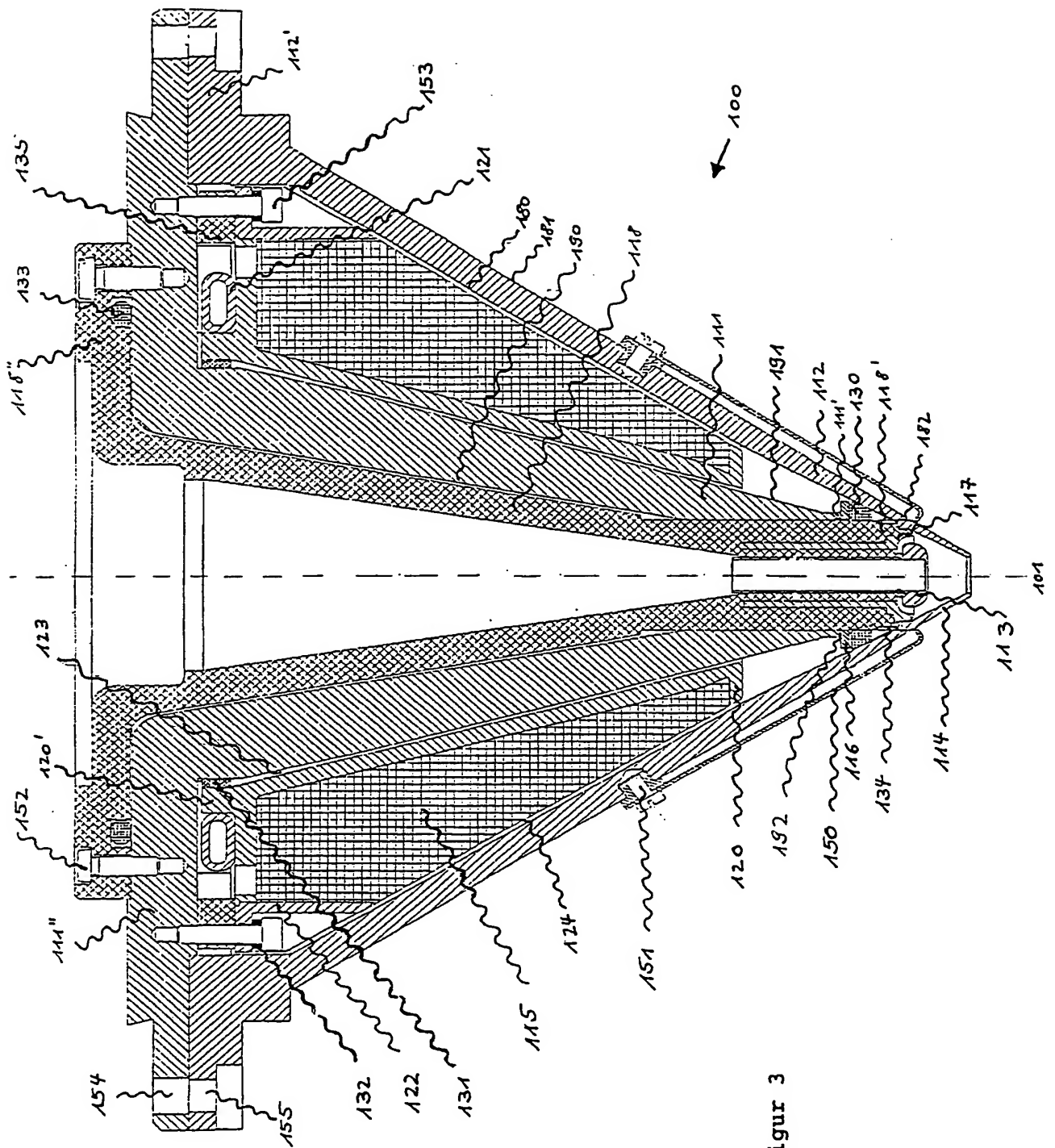


Figure 3

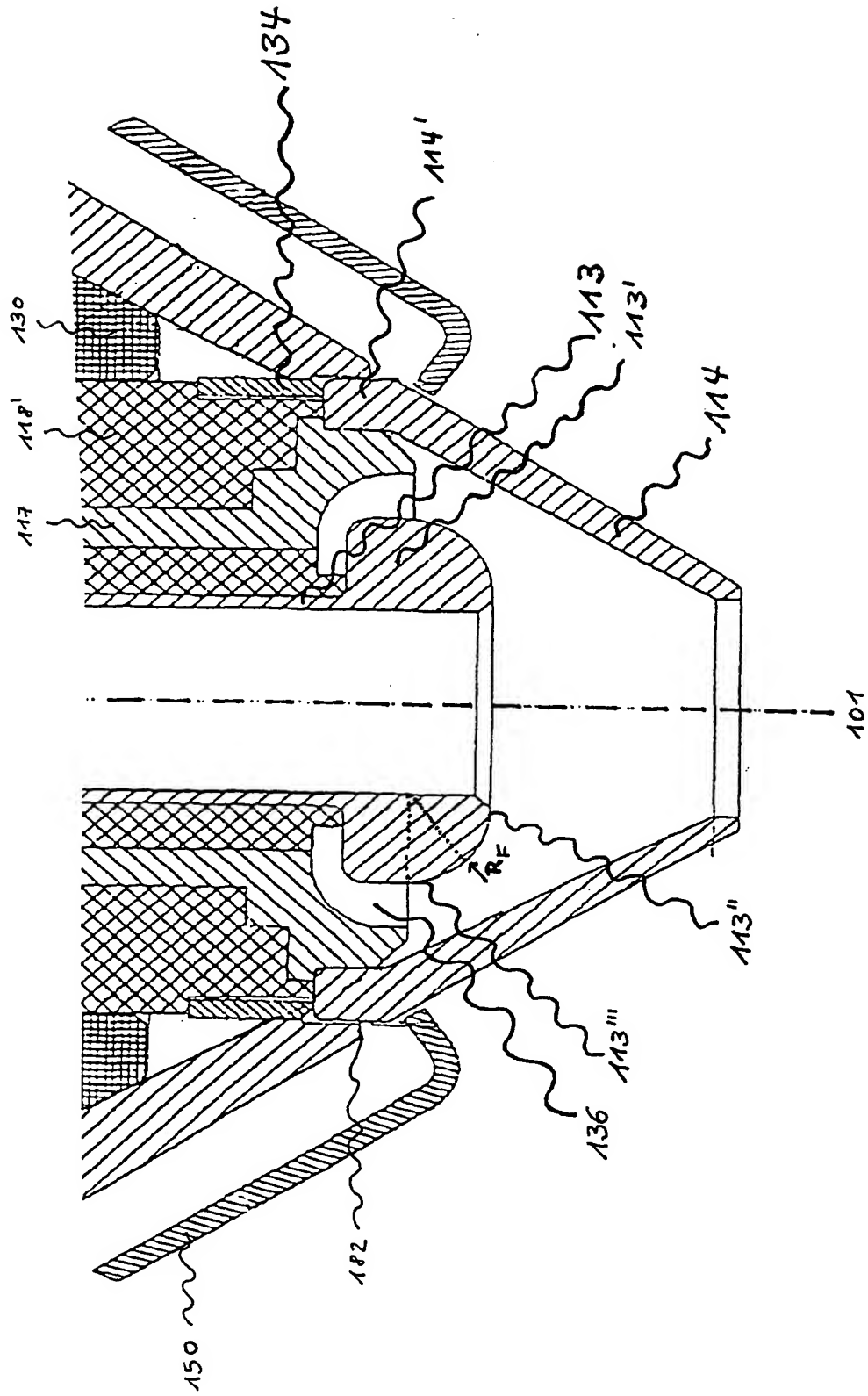
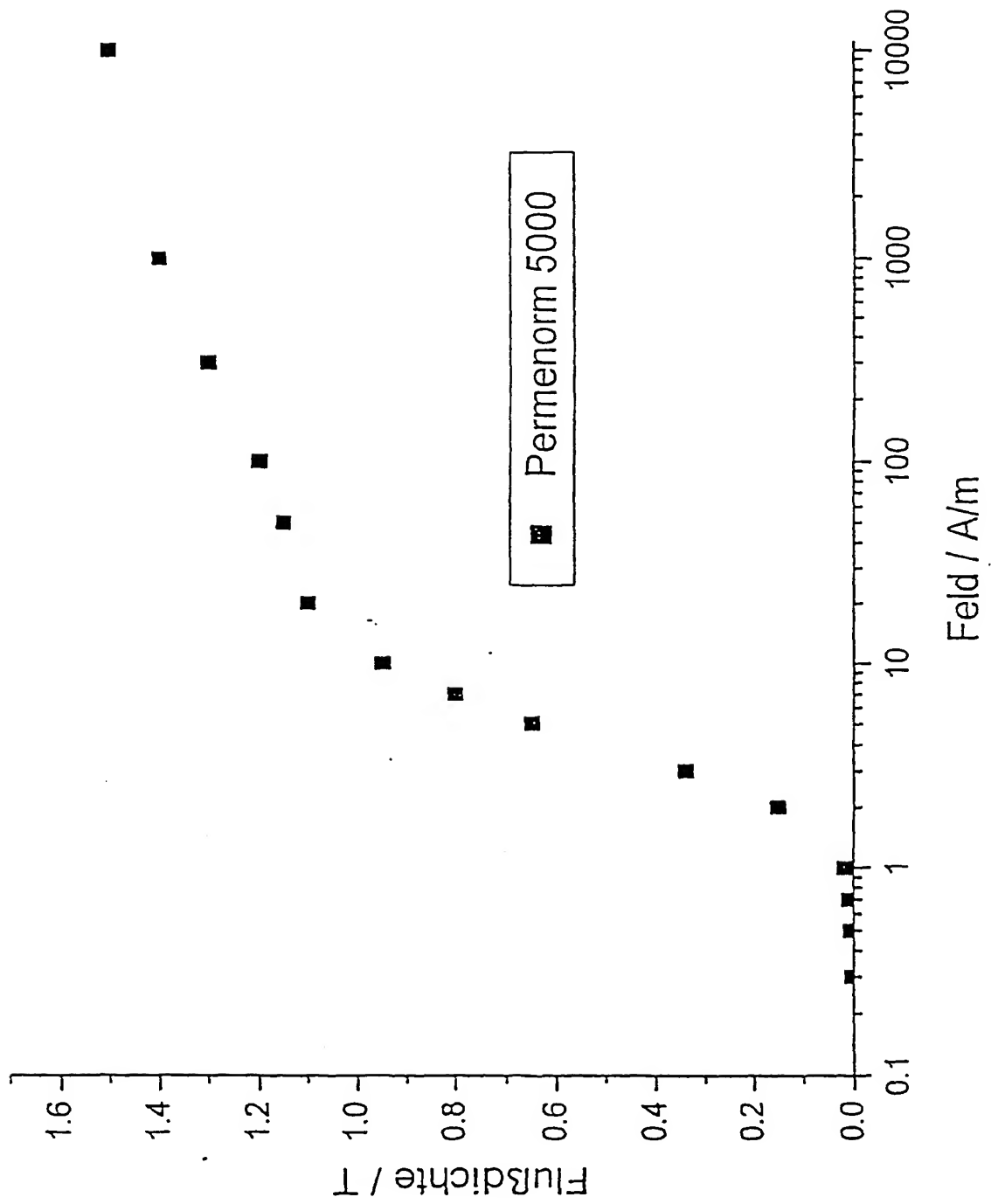
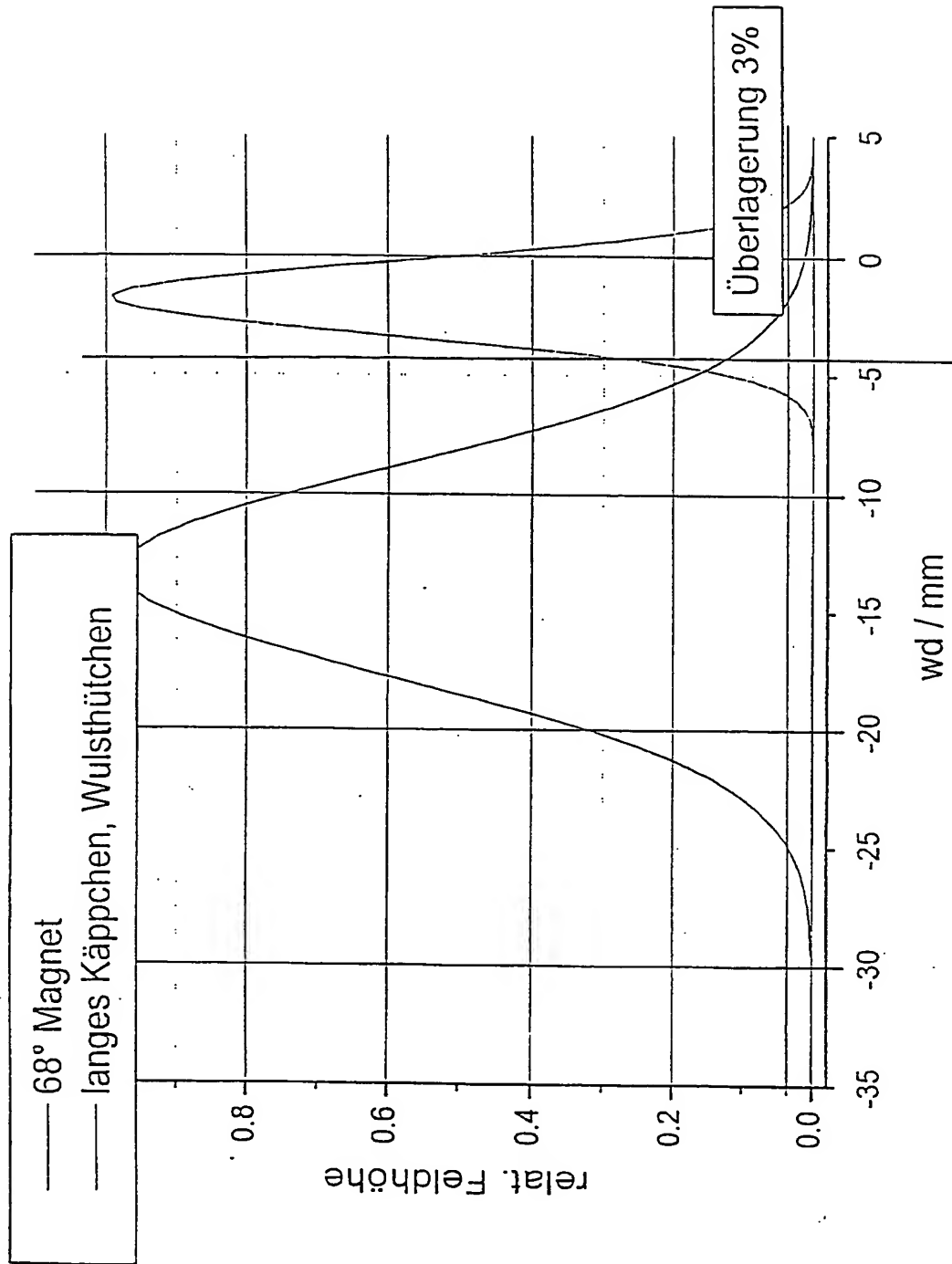


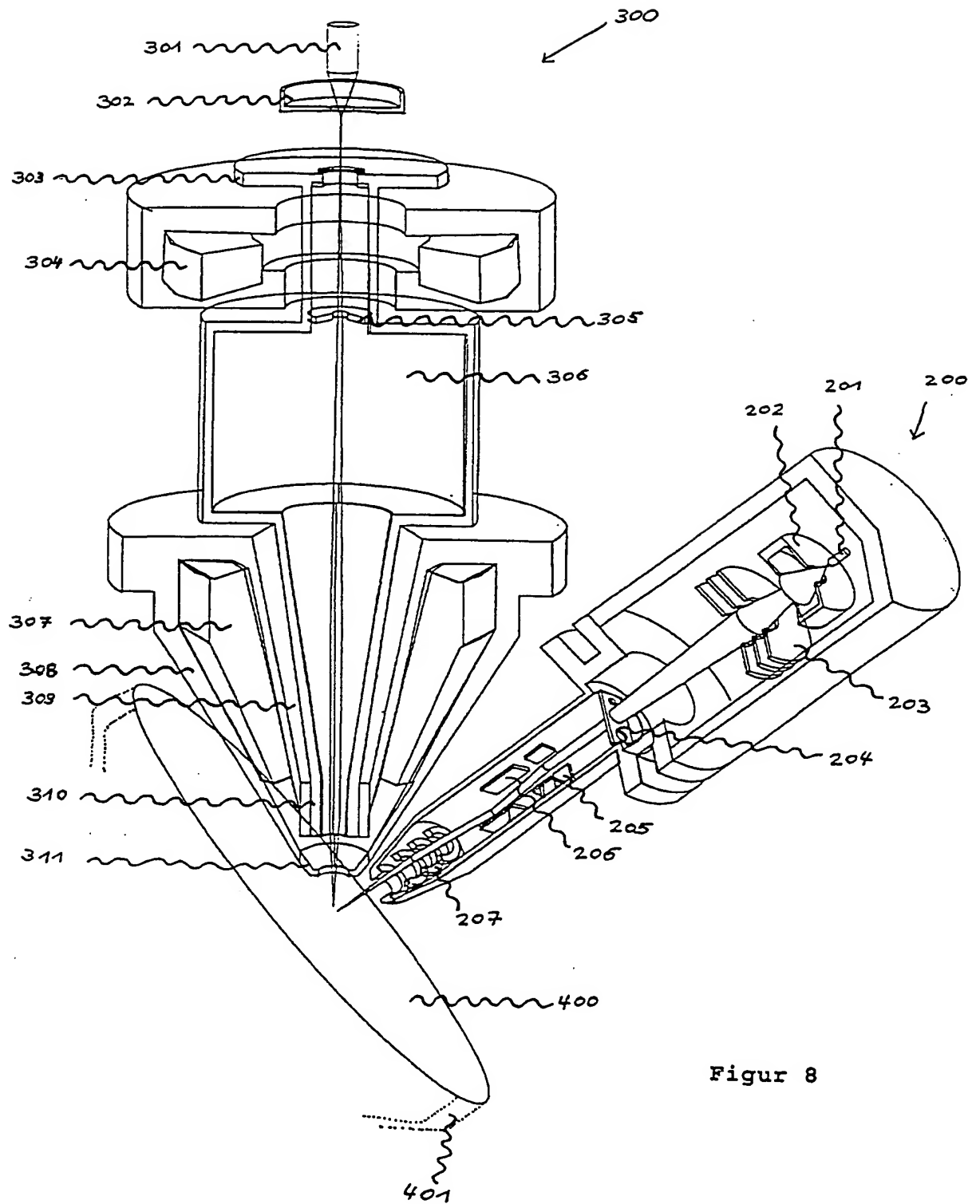
Figure 5



Figur 6



Figur 7



Figur 8